

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002433

International filing date: 17 February 2005 (17.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-041379
Filing date: 18 February 2004 (18.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

25.02.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 2 月 1 8 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 4 1 3 7 9
Application Number:

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

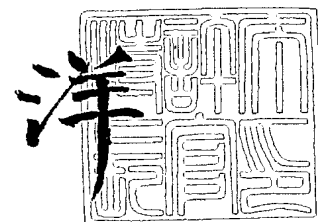
J P 2 0 0 4 - 0 4 1 3 7 9

出 願 人 日 立 化 成 工 業 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 4 月 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 16000730
【提出日】 平成16年 2月18日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G01N 1/10
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県下館市大字小川 1 5 0 0 番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内
 【氏名】 河添 宏
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝浦四丁目 9 番 2 5 号 日立化成工業株式会社内
 【氏名】 安江 清
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県下館市大字小川 1 5 0 0 番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内
 【氏名】 赤井 邦彦
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号 日化テクノサービス株式会社内
 【氏名】 井上 嘉則
【特許出願人】
 【識別番号】 000004455
 【氏名又は名称】 日立化成工業株式会社
 【代表者】 長瀬 寧次
 【電話番号】 03-5381-2403
 【連絡先】 知的財産室
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 010043
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

第一の支持体と、
マイクロ流体システムの流路として機能する、少なくとも一本の中空フィラメントとを備え、
該中空フィラメントが前記第一の支持体に任意の形状に敷設され、かつ前記中空フィラメントの内側の所定箇所が機能性を有するマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 2】

内側の所定箇所が機能性を有する中空フィラメントが、第一の支持体に任意の形状に複数本敷設された請求項 1 記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 3】

さらに、内側の所定箇所に機能性を有さない中空フィラメントが、第一の支持体に任意の形状に少なくとも一本敷設された請求項 1 又は 2 記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 4】

少なくとも一本の中空フィラメントが、他の少なくとも一本の中空フィラメントに交差するように敷設された請求項 1 ～ 3 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 5】

少なくとも一本の中空フィラメントが、該中空フィラメント自身に交差するように敷設された請求項 1 ～ 4 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 6】

さらに、第二の支持体を有し、該第二の支持体と第一の支持体との間に少なくとも一本の中空フィラメントが挟まれた構造である請求項 1 ～ 5 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 7】

少なくとも一本の中空フィラメントの一部が、第一の支持体、及び／又は、第二の支持体から露出するように敷設された請求項 1 ～ 6 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 8】

少なくとも一本の中空フィラメントが、流体を外部から注入、及び／又は、外部へ抽出するためのポートを備える請求項 1 ～ 7 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 9】

中空フィラメントの経路を連結する中継部を備える請求項 1 ～ 8 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 10】

少なくとも一本の中空フィラメントの所定箇所に金属膜が形成されている請求項 1 ～ 9 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 11】

少なくとも一本の中空フィラメントの所定箇所が光透過性を有する請求項 1 ～ 10 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 12】

機能性が、吸・脱着、イオン交換、分離、除去、分配及び酸化・還元からなる群から選ばれる少なくとも一つである請求項 1 ～ 11 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 13】

少なくとも一本の中空フィラメントの内側の所定箇所に充填材を固定することにより機能性を付与する請求項 1 ～ 12 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【請求項 14】

少なくとも一本の中空フィラメントの内側の所定箇所にグラフト重合処理を施すことにより機能性を付与する請求項 1 ～ 1 3 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

【書類名】明細書

【発明の名称】マイクロ流体システム用支持ユニット

【技術分野】

【0001】

本発明は、マイクロ流体システム用支持ユニットに関する。

【背景技術】

【0002】

化学や生化学の分野ではMEMS (Micro Electro Mechanical System) 技術を応用した反応系や分析装置の小型化に関する研究が進められている。従来は、構成要素の一つとなるマイクロポンプ、マイクロバルブといった単一機能を有する機械要素(マイクロマシン)の研究開発が行われている(例えば、非特許文献1及び2参照)。

目的の化学反応や化学分析を行うためには、マイクロマシンなどの各種部品を複数組み合わせてシステム化する必要がある。一般にそれらのシステムの完成形は、マイクロリアクター (Micro Reactor System)、マイクロ化学分析システム (Micro Total Analysis System: μ TAS) などと呼ばれている。通常、マイクロマシンは半導体製造プロセスを適用してシリコンチップ上に形成する。複数の要素を一つのチップに形成(集積)し、システム化することは、原理的には可能であり、その取り組みも実際行われている(例えば、非特許文献3参照)。しかし、その作製プロセスは複雑であり、量産レベルでこれを製造することは困難と予想されている。複数のマイクロマシン等を接続して流体回路(システム)を形成する方法として、シリコン基板の所定の位置にエッチング等で溝を形成し流路とするチップ型基板(ナノリアクター)が提案されている。上記の集積化する方法より製造ははるかに容易というメリットがある。しかし、流路断面積が小さく流体と溝側面との界面抵抗が大きく、その流路長は最大でmm単位といったところが現状であり、流路層の多層化が難しく、実際に行われる合成反応や化学分析では反応や分析の種類、ステップ数や量が制限されてしまうという点が克服されていなかった。

【0003】

【非特許文献1】 庄子, 「化学工業」, 2001年4月, 第52巻, 第4号, p.45-55

【非特許文献2】 前田, 「エレクトロニクス実装学会誌」, 2002年1月, 第5巻, 第1号, p.25-26

【非特許文献3】 伊永, 「日本学術会議50周年記念環境工学連合講演論文集」, 1999年, 第14号, p.25-32

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明は、上記課題を解決するために鋭意検討されたものである。本発明の目的は、反応や分析のステップ数や量の制限が緩く、製造が容易であるマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することである。また、本発明の他の目的は、複雑な流体回路を高密度に実装できるマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記目的を達成するために、本発明の請求項1に記載の発明は、第一の支持体と、マイクロ流体システムの流路として機能する、少なくとも一本の中空フィラメントとを備え、該中空フィラメントが前記第一の支持体に任意の形状に敷設され、かつ前記中空フィラメントの内側の所定箇所が機能性を有するマイクロ流体システム用支持ユニットである。

中空フィラメントを流路として用いるため、精度がよく、製造が容易であり、且つ反応や分析のステップ数や量を制限しない多機能のマイクロ流体システムを提供することができる。

請求項2に記載の発明は、内側の所定箇所が機能性を有する中空フィラメントが、第一の支持体に任意の形状に複数本敷設された請求項1記載のマイクロ流体システム用支持ユ

ニットである。

請求項 3 に記載の発明は、さらに、内側の所定箇所に機能性を有さない中空フィラメントが、第一の支持体に任意の形状に少なくとも一本敷設された請求項 1 又は 2 記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 4 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントが、他の少なくとも一本の中空フィラメントに交差するように敷設された請求項 1 ～ 3 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 5 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントが、該中空フィラメント自身に交差するように敷設された請求項 1 ～ 4 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

立体的に敷設することができるため、精度がよく、製造が容易で、且つ反応や分析のステップ数や量を制限しない。更に、多機能のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することができる。また、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供することができるため、マイクロ流体システム自体のコンパクト化を図ることもできる。

請求項 6 に記載の発明は、さらに、第二の支持体を有し、該第二の支持体と第一の支持体との間に少なくとも一本の中空フィラメントが挟まれた構造である請求項 1 ～ 5 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 7 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントの一部が、第一の支持体、及び／又は、第二の支持体から露出するように敷設された請求項 1 ～ 6 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

これにより、外部部品や装置との接続を容易に行なうことができる。

【0006】

請求項 8 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントが、流体を外部から注入、及び／又は、外部へ抽出するためのポートを備える請求項 1 ～ 7 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 9 に記載の発明は、中空フィラメントの経路を連結する中継部を備える請求項 1 ～ 8 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

これにより、互いに機能が異なるチューブを容易に接続でき、多段の反応などを行うことができる。

【0007】

請求項 10 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントの所定箇所に金属膜が形成されている請求項 1 ～ 9 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 11 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントの所定箇所が光透過性を有する請求項 1 ～ 10 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 12 に記載の発明は、機能性が、吸・脱着、イオン交換、分離、除去、分配及び酸化・還元からなる群から選ばれる少なくとも一つである請求項 1 ～ 11 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 13 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントの内側の所定箇所に充填材を固定することにより機能性を付与する請求項 1 ～ 12 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

請求項 14 に記載の発明は、少なくとも一本の中空フィラメントの内側の所定箇所にグラフト重合処理を施すことにより機能性を付与する請求項 1 ～ 13 いずれか 1 項記載のマイクロ流体システム用支持ユニットである。

多種多様な吸／脱着、分配、分離、濃縮等の化学操作を簡単な構造で逐次的にかつ多段に構築することができる。その結果、反応や分析のステップ数や量を制限しない更に多機能のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することができる。また、更に、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供する

ことができるため、マイクロ流体システム自体のコンパクト化を図ることもできる。

【発明の効果】

【0008】

本発明のマイクロ流体システム用支持ユニットは製造が容易である。また、反応や分析の工程数や量の制限が緩い。また、cm単位の長い距離の流路長を得ることができる。

この結果、本発明のマイクロ流体システム用支持ユニットは、精度がよく、製造ばらつきが少ない流体回路（マイクロ流体システム）を提供することができる。また、立体的に少なくとも一本の中空フィラメントを交差させることができるため複雑な流体回路の小型のマイクロ流体システムを提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号で表している。ただし、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なる。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を照らし合わせて判断するべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。

【0010】

図1に示すように、本発明の第一の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットは、第一の支持体1と、この第一の支持体1に任意の形状に敷設された複数の中空フィラメント501, 502, 503, ..., 508と、この複数の中空フィラメントに交差する方向に敷設された複数の中空フィラメント511, 512, 513, ..., 518とを備える。これらの複数の中空フィラメントの第一の支持体1とは反対側に第二の支持体2を有し、複数の中空フィラメント501, 502, 503, ..., 508, 511, 512, 513, ..., 518が第一の支持体1と第二の支持体2との間に挟まれた構造をとっている。これらの複数の中空フィラメント501, 502, 503, ..., 508, 511, 512, 513, ..., 518の内側には機能性を有する所定箇所301, 302, ..., 308, 311, 312, ..., 318が備えられている。また、これらの複数の中空フィラメントは、それぞれ第一の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの薬液の流路層を構成している。

【0011】

複数の中空フィラメントの内径及び外径は目的に応じて選択すればよいが、単位時間当たりの流量がミリリットル (mL) ~ マイクロリットル (μ L) 単位となる場合が多いと考えられるので、内径は、 $\phi 0.01$ mm ~ 1.0 mm 程度であることが好ましい。このような径の中空フィラメントを作製する場合は、ポリイミド (PI)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリエーテルイミド (PEI)、ポリフェニレンサルファイド (PPS)、4フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合体 (PFA) などの材質が特に適している。 $\phi 0.01$ mm 以下の内径にすると、中空フィラメントの内壁面と流体との界面抵抗の影響が無視できなくなり、詰まりなどの不具合を生じやすい傾向がある。一方、 $\phi 1.0$ mm より大きい内径では流体を連続的に流すためには高圧が必要となり他の部品への負担が増え、また、流体中への気泡の混入等が生じてしまう可能性がある。複数の中空フィラメントに流している流体に化学反応を生じさせる場合は、中空フィラメントは耐薬品性を有するものがよい。

【0012】

中空フィラメントの内側の所定箇所が有する機能性としては、例えば、吸・脱着、イオン交換、分離、除去、分配、酸化・還元等が挙げられる。

機能性を充填材の充填により中空フィラメントに付与する場合は、例えば、無機系充填剤、樹脂系充填剤等から目的に応じた充填材を選んでよい。無機系充填剤としては、例えば、シリカゲル、活性炭、アルミナ、ジルコニア、チタニア等を基材としたものなど挙げられる。なお、シリカゲル充填剤は塩基性の水溶液に溶解するため、pHは8以下で使用するが好ましい。樹脂系充填剤としては、例えば、スチレンージビニルベンゼン共重

合体、ポリメタクリレート等の合成ポリマーゲル、天然高分子ゲルなどが挙げられる。樹脂系充填材は目的に応じて、硬さ、細孔の大きさなどを制御することが容易であり、また、幅広い pH 範囲 (pH 2 ~ 13 程度) で使用できる。目的に応じて、これら充填材の表面に所定の DNA プロブ、抗体、イオン交換基を導入してもよく、また、触媒作用のある金属などを担持させてもよい。

【0013】

機能性をグラフト重合処理によって付与する場合は、例えば、放射線グラフト重合法が好ましい。例えば、チューブの所定箇所に電子線、ガンマ線等の高エネルギーの放射線を照射し、ラジカルを生成させ、グリシジルメタクリレート (GMA) モノマーをチューブに流すとグラフト重合側鎖が生成する。この側鎖に目的とする機能基を導入するという方法である。任意形状のチューブの所定箇所に機能基を導入することが、様々な機能を付与することができるので好ましい。

【0014】

また、中空フィラメントに流している流体に光を照射し、光化学反応を生じさせたり、分光分析を行う場合は、光化学反応を生じさせたり、分光分析を行う中空フィラメントの所定箇所に光透過性があるとよい。光透過率は目的に応じた値でよいが、目的波長において 80% 以上であることが好ましく、90% 以上であることがより好ましい。この場合、中空フィラメントの所定箇所に隣接する部分の第一の支持体 1、及び/又は、第二の支持体 2 が上述のような光透過率を有するか、又は、図 4 (a) に示すように、第一の支持体 1、及び/又は、第二の支持体 2 に露出窓を設け中空フィラメント 58 を露出させることが好ましい。

【0015】

中空フィラメントを第一の支持体に敷設し、好ましくは固定することは、中空フィラメント単体の場合と比較して、周囲の温度、電場、磁場等様々な環境を制御し易いという優れたメリットがある。このことは、化学反応、化学分析等を行う際に有利であり、特にマイクロ化された反応系及び分析系においては好ましい。また、その他の部品とのアライメントが容易で接続し易く、多数の中空フィラメントをコンパクトに収容できるという利点もある。

【0016】

化学分析を行う場合、複数の中空フィラメントを有していることが作業効率を高める点でよい。この場合、複数の中空フィラメントは、反応時間、泳動距離、エネルギー印可量等の条件を等しくするという観点から、互いに等長であることが好ましい。つまり、試料の流入部から流出部まで外部から受けるエネルギー量が均一であり、更に他の中空フィラメントが受けるエネルギー量ともほとんど差がないことが好ましい。この様な観点から、中空フィラメントに伝わる熱の分布が均一になるように中空フィラメントが 2 枚以上の支持体間に挟まれていることが好ましい。また、複数の中空フィラメントの管の厚みは均一である方が好ましい。

【0017】

中空フィラメントは、例えば、市販の各種材質のチューブを使用することができ、目的に応じて任意の材質のものを選択することができる。それらの例としては、ポリ塩化ビニル樹脂 (PVC)、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂 (PVA)、ポリスチレン樹脂 (PS)、スチレン・アクリロニトリル・ブタジエン共重合体 (ABS)、ポリエチレン樹脂 (PE)、エチレン・酢酸ビニル共重合体 (EVA)、ポリプロピレン樹脂 (PP)、ポリ 4-メチルペンテン (TPX)、ポリメチルメタクリレート (PMMA)、PEEK、PI、PEI、PPS、酢酸セルロース、四フッ化エチレン樹脂 (PTFE)、4 フッ化・6 フッ化プロピレン樹脂 (FEP)、PFA、4 フッ化エチレン・エチレン共重合体 (ETFE)、3 フッ化塩化エチレン (CTFE)、フッ化ビニリデン (PVDF)、ポリエチレンテレフタレート樹脂 (PET)、ポリアミド樹脂 (ナイロン)、ポリアセタール (POM)、ポリフェニレンテレフタレート (PPO)、ポリカーボネート樹脂 (PC)、ポリウレタン樹脂、ポリエステルエラスト

マ、ポリオレフィン樹脂、シリコン樹脂、ポリイミド樹脂等の有機材質や、ガラス、石英、カーボン等の無機材質などが挙げられる。

【0018】

第一の支持体、第二の支持体等の支持体の材質、形状、サイズなどは目的に応じて選定すればよく、板厚、フィルム厚等の適正な範囲は目的や求められる機能によって異なることが多い。例えば、電気絶縁性を求める場合は、プリント配線板等に用いられているエポキシ樹脂板、ポリイミド樹脂板など、フレキシブル配線板等に用いられているデュポン社製のカプトンフィルムに代表されるようなポリイミドフィルム、東レ社製のルミラーフィルムに代表されるようなPETフィルムなどを選定することが好ましい。第一の支持体の板厚（フィルム厚）は厚い方が好ましく、0.05mm以上であることより好ましい。

また、第一の支持体に放熱性を求める場合は、アルミ（Al）、銅（Cu）、ステンレス、チタン（Ti）等の金属製の箔や板を選定することが好ましい。この場合、第一の支持体の板厚は更に厚い方が好ましく、0.5mm以上であることがより好ましい。

また、第一の支持体に光透過性を求める場合は、ガラス、石英板等の無機材料の板やフィルム、ポリカーボネート、アクリル等の有機材料の板やフィルムなどを選定することが好ましい。第一の支持体の板厚（フィルム厚）は薄い方が好ましく、0.5mm以下であることより好ましい。

更に、支持体として、表面に銅等の金属パターンをエッチング、めっき等で形成したいわゆるフレキシブル回路基板やプリント回路基板などを用いてもよい。このことで、マイクログラフ、発熱素子、圧電素子、温度・圧力・歪み・振動・電圧・磁界等の各種センサーや抵抗・コンデンサ・コイル・トランジスタやICなどの電子部品、更に半導体レーザー（LD）、発光ダイオード（LED）、及びフォトダイオード（PD）などの光部品など、様々な部品や素子を実装する端子や回路を形成でき、システム化が容易になる。

【0019】

中空フィラメントの固定を容易にする目的で、第一の支持体、及び／又は、第二の支持体の表面に接着剤の層（接着層8）を設けてもよい。それらの例としては、国際公開WO 03/070623号公報記載のものが好適に挙げられる。

また、中空フィラメントに流体を外部から注入、及び／又は、外部へ抽出するためにポートを有することが好ましい。これらポートの構造や形状は任意でよい。例えば、図2（a）に示すように中空フィラメント58の内径若しくは外径と同程度又はそれ以下の径の穴41をレーザー加工、切削加工等で形成し、シリコンゴム等で蓋をする方法や、図2（b）に示すように、やはり同径程度の径を有するニードル42を中空フィラメント58に突き刺し、該ニードル42を固定する方法などがある。穴41やニードル42の大きさは基本的に任意でよいが、倍以上の大きさになると無駄な容量が増加しマイクロ化のメリットが減少してしまったり、気泡などの混入を引き起こす原因となるので、注意が必要である。

【実施例】

【0020】

（例1）

第一の支持体1に、接着剤層として厚さ250 μ mで室温で粘着性であるスリーエム社製VBH A-10フィルム有した厚さ75 μ mのデュポン社製カプトン300Hを用いた。この第一の支持体1の所望の位置に、超音波振動と荷重の出力制御が可能でNC制御でX-Yテーブルを可動できるNC配線装置を用い、仁礼工業株式会社の高機能エンブラチューブ（材質：PEEK、内径0.2mm、外形0.4mm）62からなる中空フィラメント501～508、511～518を敷設する。敷設する中空フィラメント501～508、511～518には、荷重80gと周波数30kHzの超音波による振動をかけ、半径5mmの円弧状に行い、交差する部分も設けた。第二の支持体2として、デュポン社製カプトン300Hを用い、複数の中空フィラメント511～518からなる第二の中空フィラメント群を敷設した。その後、プリント基板用の小径穴あけ用途のレーザ穴あけ機を用い、パルス幅5ms、ショット数4ショットで ϕ 0.2mmの穴を0.1mm間隔

で移動させて、図 1 (b) に示す所望の切断線に沿って、幅広の十字の形に外形加工する。その後、中空フィラメント 501~508, 511~518 の端部付近の第一の支持体 1 の所定部分を除去し、8 本の全長 20 cm の中空フィラメント 501~508 からなる第一の中空フィラメント群、及び 8 本の全長 20 cm の中空フィラメント 511~518 からなる第二の中空フィラメント群を、それぞれの端部の 10 mm の長さを露出させた形状でマイクロ流体システム用支持ユニットを作製する。敷設部分全般、特に交差する部分で中空フィラメントの破損はない。

この結果、複数の中空フィラメント 501~508 からなる第一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント 511~518 からなる第二の中空フィラメント群で形成した流路の位置ばらつきは、設計図面に対し、 $\pm 10 \mu\text{m}$ 以内に収まる。マイクロ流体システム用支持ユニットを温度調節器内に入れ、 80°C に保ち、液状の着色インクを一方の端から流入し、流出までの時間をストップウォッチ等の計測機器で計測した場合、8 本ともほぼ同じタイミング (± 1 秒以下) で他端から流出する。

【0021】

(例 2)

第一の支持体 1 に、厚さ $100 \mu\text{m}$ の非粘着型感圧接着剤ダウコーニングアジア社製の S9009 を有した厚さ 0.5 mm のアルミ板を用いた。これに、超音波振動と荷重の出力制御が可能で NC 制御で X-Y テーブルを可動できる NC 配線装置を用い、ハギテック社のガラスチューブ ESG-2 (内径 0.8 mm 外径 1 mm) を敷設する。敷設する中空フィラメント 501~508, 511~518 には、荷重 100 g と周波数 20 kHz の超音波による振動をかける。中空フィラメント 501~508, 511~518 の敷設は、半径 10 mm の円弧状に行い、交差する部分も設ける。その交差する部分の近傍では、荷重と超音波振動を止めることとする。第二の支持体 2 には、デュポン社製カプトン 200H を用い、真空ラミネートを用いて中空フィラメント 501~508, 511~518 を施設した支持ユニット上にラミネートする。その際、流入部、流出部、及び交差部の中空フィラメント 501~508, 511~518 近傍に温度測定用の熱電対を埋め込む。その後の外形加工では、プリント基板用の外形加工機を用いて所望の形に切断する。所定部分の支持体を除去し、12 本の全長 40 cm の中空フィラメント 501~508, 511~518 を 50 mm の長さを露出させた形状のマイクロ流体システム用支持ユニットを作製できる。中空フィラメント 501~508, 511~518 で形成した流路の位置ばらつきは設計図面に対し、 $\pm 20 \mu\text{m}$ 以内に収まる。敷設部分全般、特に交差配線部分で中空フィラメント 501~508, 511~518 の破損はない。

共立電子産業製のフィルムヒート FTH-40 をアルミ板裏面の全面に貼り付け 90°C に設定する。約 20°C の水を一方の端から流入し、他端から流出した水の温度を測定したところ、 $88 \pm 1^\circ\text{C}$ である。又、流入部、流出部、及び交差部の各温度は $89 \pm 0.5^\circ\text{C}$ であり、精度良い温度制御が可能である。

【0022】

(例 3)

第一の支持体 1 に、室温で非粘着性接着剤であるダウコーニングアジア社製 S9009 (厚さ $200 \mu\text{m}$) を有した厚さ $35 \mu\text{m}$ の銅はくを用いた。これに超音波振動と荷重の出力制御が可能で NC 制御で X-Y テーブルを可動できるマルチワイヤ用布線機を用い、仁礼工業株式会社の高機能エンブラチューブ (材質: PEEK、内径 0.2 mm、外形 0.4 mm) を敷設する。敷設する中空フィラメント 58 には、荷重 80 g と周波数 30 kHz の超音波による振動をかける。中空フィラメント 58 の敷設は、半径 5 mm の円弧状に行い、交差する部分も設ける。その交差部の近傍では、荷重と超音波振動を止めることとする。第二の支持体 2 として、ダウコーニングアジア社製 S9009 (厚さ $200 \mu\text{m}$) を有したデュポン社製カプトン 200H を用い、真空ラミネートで中空フィラメント 58 を敷設した表面にラミネートする。

その後、中継部 8 となる箇所第二の支持体 2、中空フィラメント 58 に対して、プリント基板用の小径穴あけ用途のレーザ穴あけ機を用いパルス幅 5 ms、ショット数を 4 シ

ヨットで $\phi 0.2\text{ mm}$ の穴をあける。その後、ルーターで外形加工し、複数の流路が接続した中継部 8 を有するマイクロ流体システム用支持ユニットを作製できる。

【0023】

(その他の実施の形態)

本発明は上記の形態によって記載したが、この開示の一部をなす部分及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。例えば、マイクロ流体システム用支持ユニットの一部に貫通孔を設け、カム付きモータなどで中空フィラメント 58 の一部に時間周期的な力を加えこの箇所の中空フィラメントを変形させ、この箇所にある流体を移動させて、脈動流を生じさせるマイクロポンプ、若しくはマイクロバルブのような使い方をする場合、中空フィラメント 58 に弾性があるとよい。特に、中空フィラメント 58 は、ヤング率で 10^3 MPa 以下であることが好ましい。

又、露出した中空フィラメント 58 の一部に金属膜 59 を形成し、電圧などを印加するための端子を形成することができる。この場合、Cu、Al、ニッケル (Ni)、クロム (Cr)、金 (Au)、等を単層、或いは多層化してめっきや蒸着などで形成するとよい。

又、マイクロ流体システム用支持ユニットは、図 3 (a)、図 3 (b) に示すように、開口部である中継部 6 を備えていたが、中継部 6 が流体の混合又は分岐のみを行う場合、第二の支持体 2 を除去加工しないで閉ざした構造にしてもよい。

更に、中空フィラメントと中空フィラメントの交差は、必ずしも 90 度に直交している必要はなく、交差していればよい。

一方、中空フィラメントは必ずしも交差させる必要はなく、図 5 及び図 6 に示すように、一方向に走行する複数の中空フィラメント 501~508 のみから構成してもよい。又、図 7 に示すように、湾曲を描く複数の中空フィラメント 511~518 を敷設してもよい。

尚、中空フィラメントは、必ずしも複数敷設されていなくてもよく、即ち中空フィラメントは単数であってもよい。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図 1】図 1 (a) は、本発明の第一の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの断面図で、図 1 (b) は、A-A 線矢印方向から見た断面図が図 1 (a) に対応する平面図である。

【図 2】図 2 (a) は、本発明の第二の実施の形態に係るポート (穴) を備えるマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図で、図 2 (b) は、本発明の第二の実施の形態に係るポート (ニードル) を備えるマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図である。

【図 3】図 3 (a) は、本発明の第二の実施の形態に係る中継部を備えるマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図で、図 3 (b) は、図 3 (a) の A-A 線方向の断面図である。

【図 4】本発明のその他の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニット用中空フィラメントの構造を説明する鳥瞰図である。

【図 5】図 5 (a) は、図 5 (c) に示す本発明の更に他の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの平面図の A-A 線矢印方向から見た断面図、図 5 (b) は、図 5 (c) に示す平面図の B-B 線矢印方向から見た断面図である。

【図 6】本発明のその他の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図である。

【図 7】本発明のその他の実施の形態に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図である。

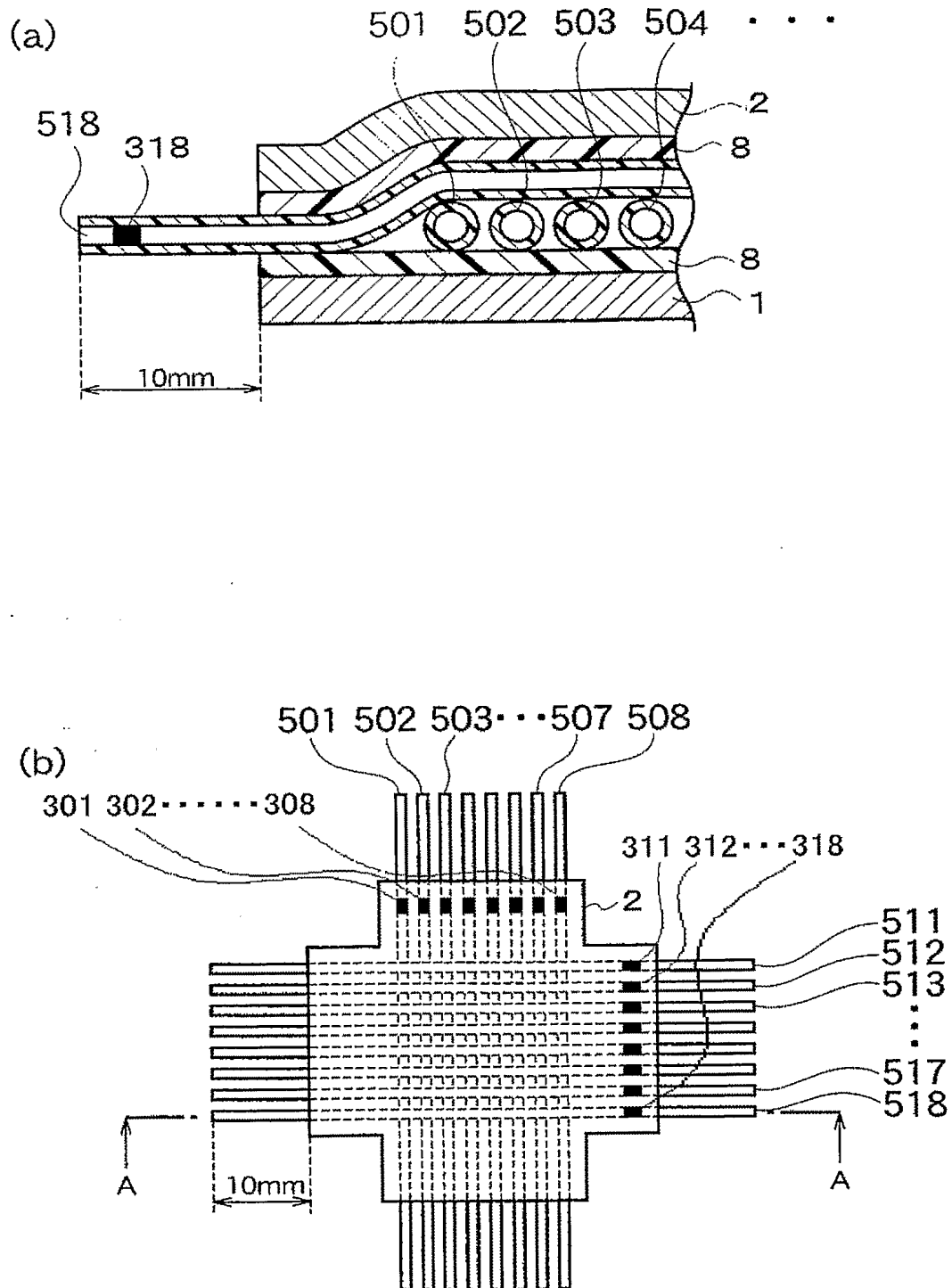
【符号の説明】

【 0 0 2 5 】

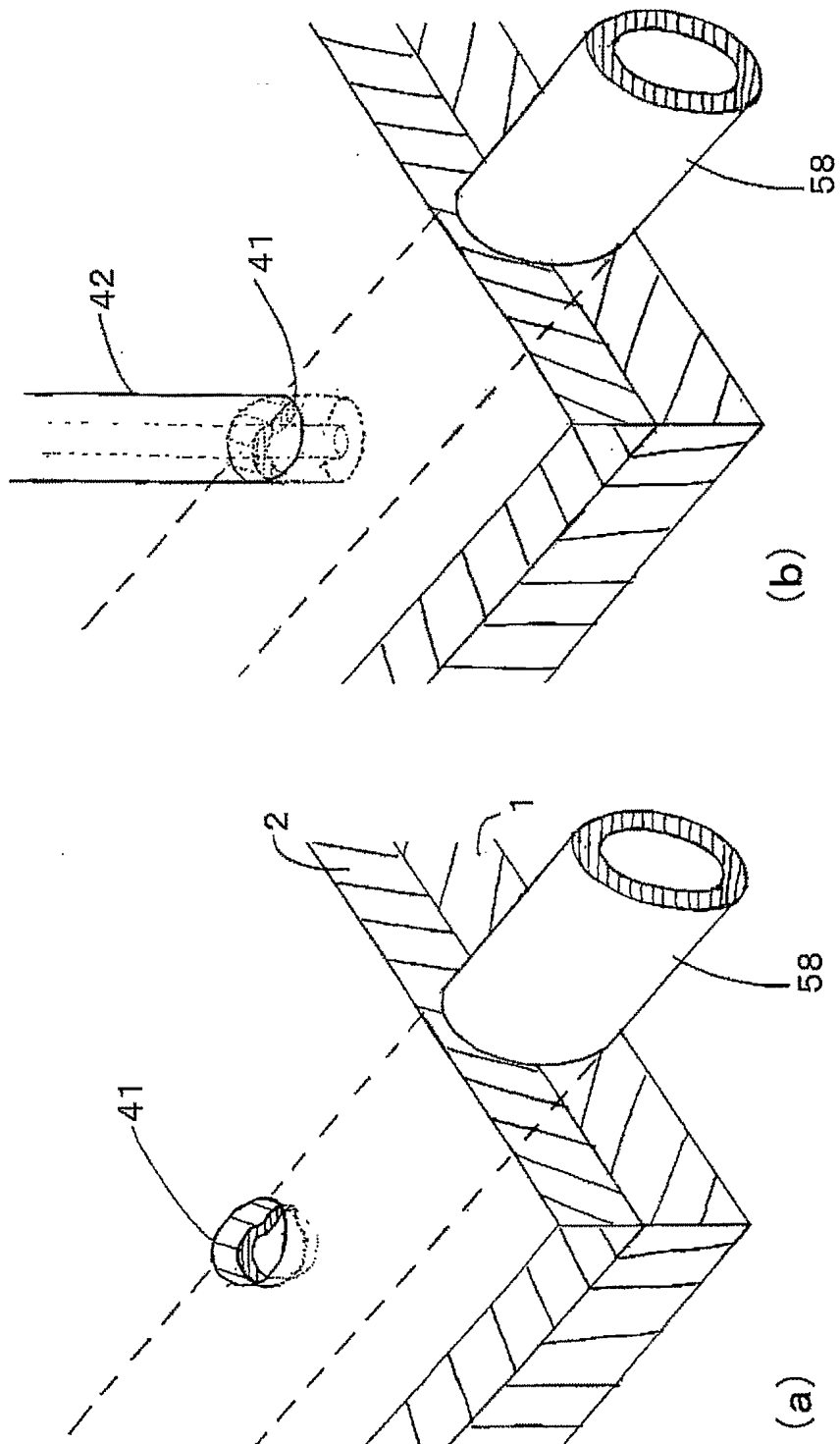
- 1 第一の支持体
- 2 第二の支持体
- 3 0 1 ~ 3 0 8 , 3 1 1 ~ 3 1 8 機能性を付与した所定箇所
- 4 1 ポート (穴)
- 4 2 ポート (ニードル)
- 5 8 , 5 0 1 ~ 5 0 8 , 5 1 1 ~ 5 1 8 中空フィラメント
- 5 9 金属膜
- 6 中継部
- 7 1 充填材を充填し機能性を付与した所定箇所
- 7 2 グラフト重合処理を施し機能性を付与した所定箇所
- 8 接着層
- 9 露出窓

【書類名】 図面

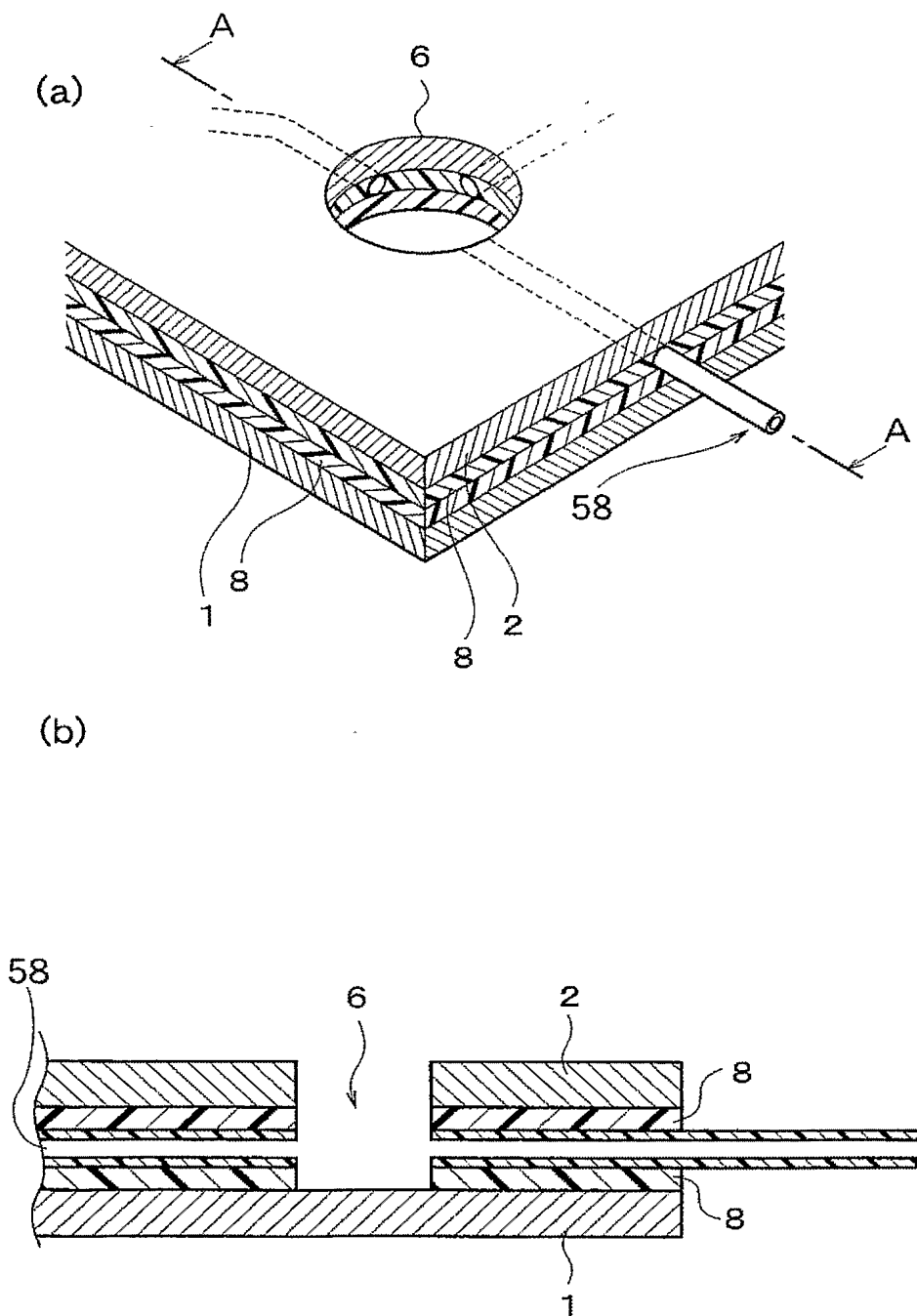
【図 1】



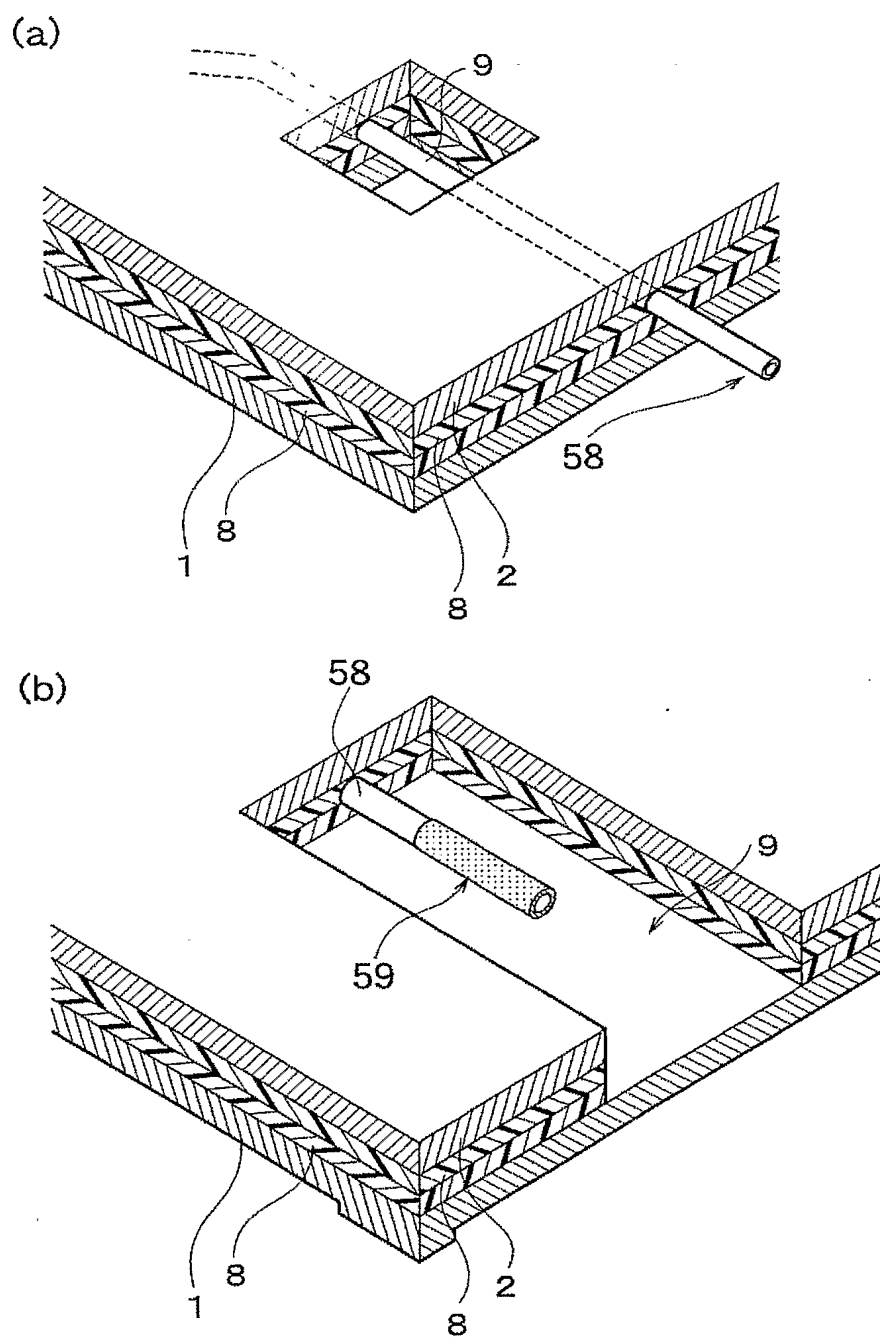
【図 2】



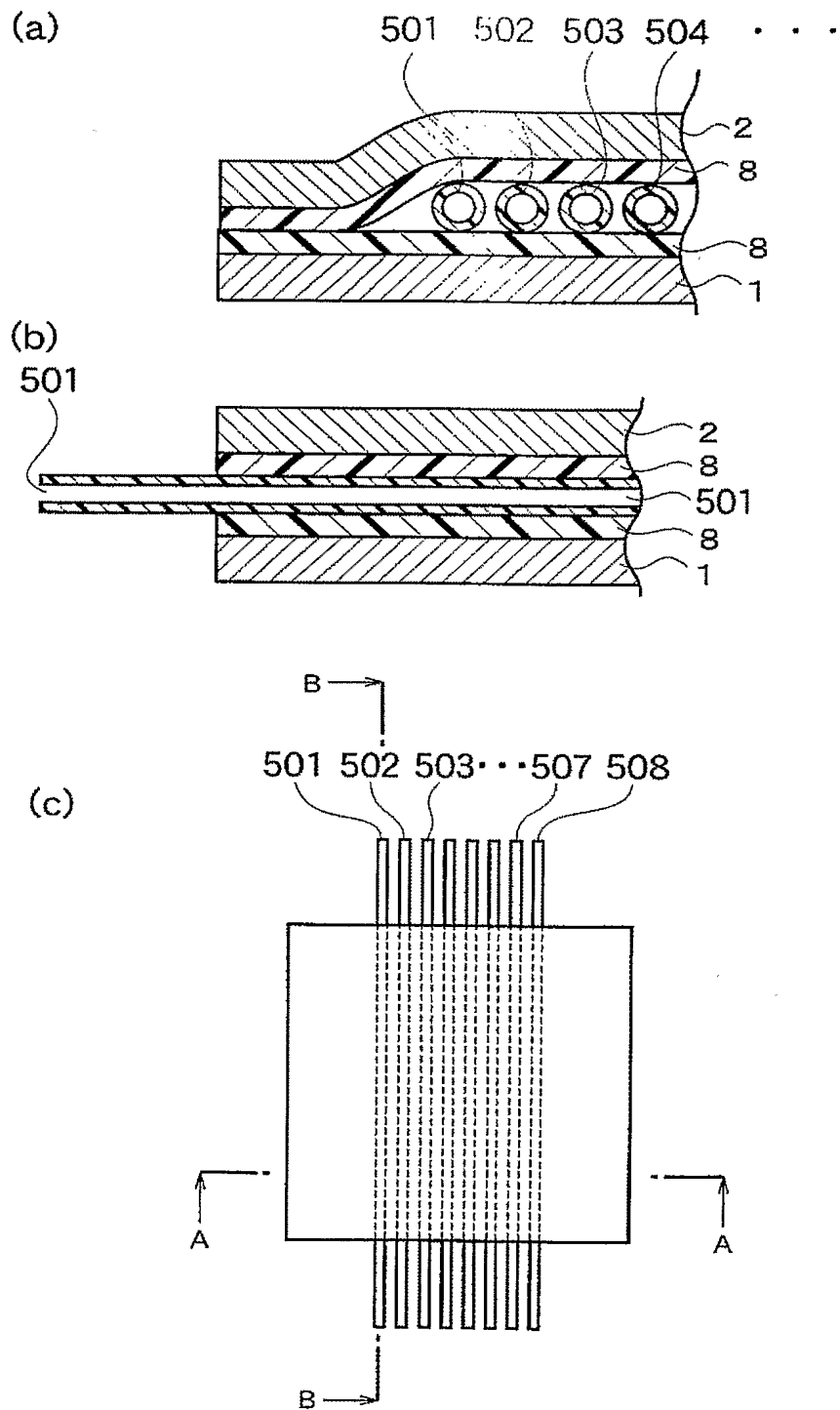
【図 3】



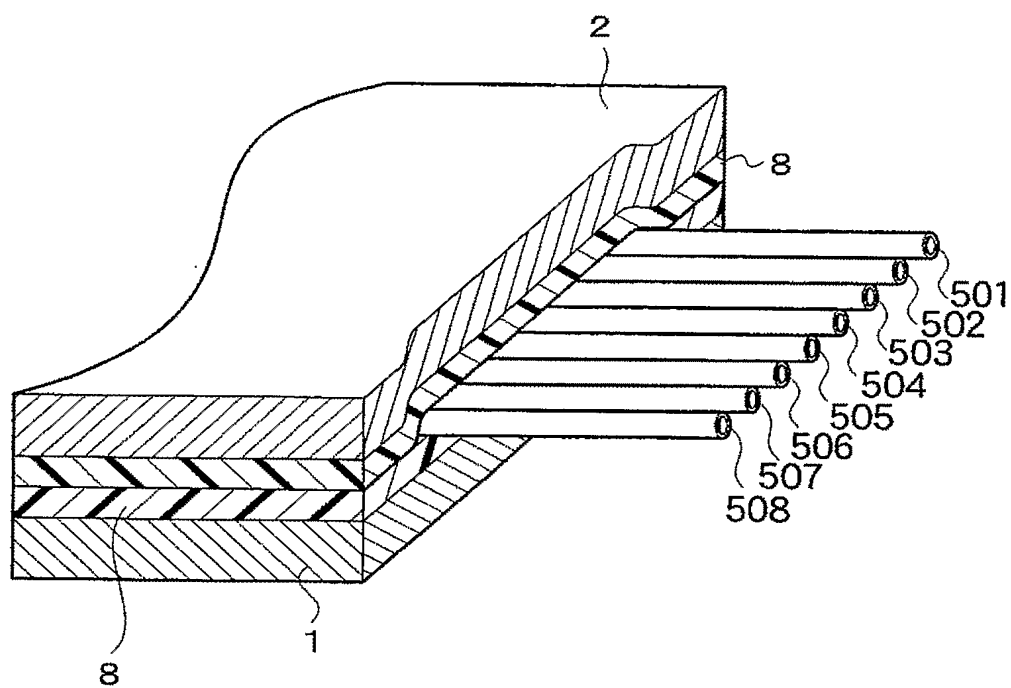
【図 4】



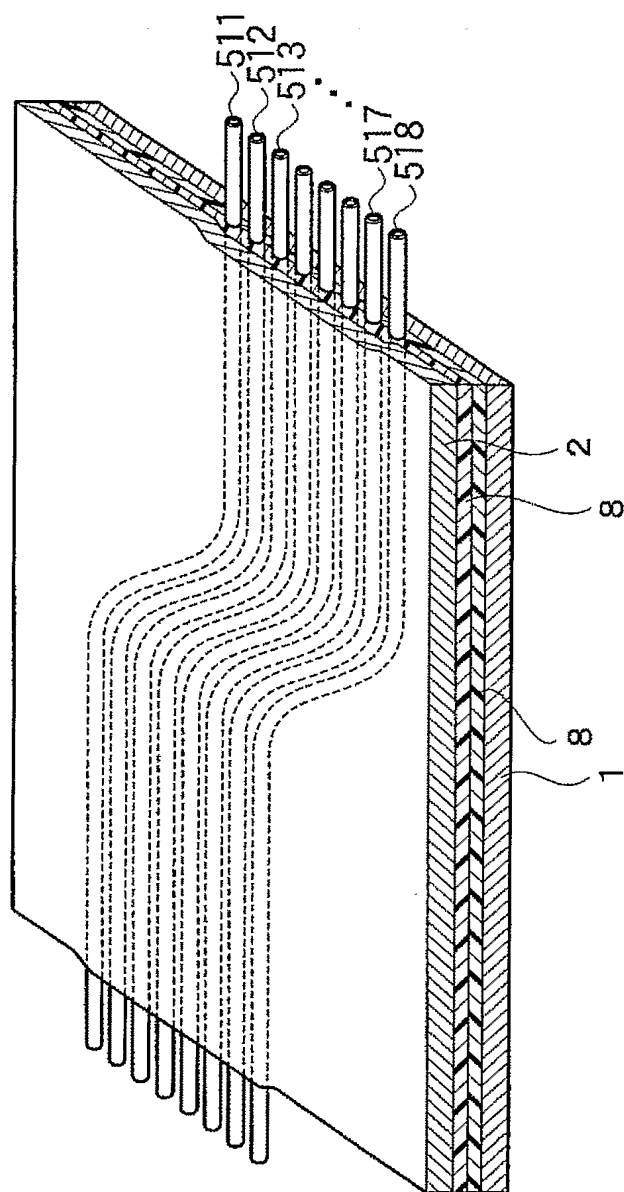
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 反応や分析のステップ数や量の制限が緩く、製造が容易であるマイクロ流体システム用支持ユニット、さらに、複雑な流体回路を高密度に実装できるマイクロ流体システム用支持ユニットを提供する。

【解決手段】 第一の支持体と、マイクロ流体システムの流路として機能する、少なくとも一本の中空フィラメントとを備え、該中空フィラメントが前記第一の支持体に任意の形状に敷設され、かつ前記中空フィラメントの内側の所定箇所が機能性を有するマイクロ流体システム用支持ユニット。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 4 - 0 4 1 3 7 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 4 5 5]

1. 変更年月日

1 9 9 3 年 7 月 2 7 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号

氏 名

日立化成工業株式会社